ヒステリシスの大きな空気圧式調節弁に使用する 電子式ポジショナの高性能化

涌井徹也*・橋詰 匠**・西島剛志***・石井 実***

Performance Improvement of Electronic Positioner for Pneumatic Control Valve with Large Hysteresis

Tetsuya WAKUI* • Takumi HASHIZUME** • Takashi NISHIJIMA*** • Minoru ISHII***

Abstract: The valve positioner will confront into various kinds of problems when controlling the control valve. Especially, when a digital positioner is attached to the control valve with a large grand friction, it often invites hunting behaviors due to the integrator in control algorithm. Further, the control valves which operates under conditions of high pressure and temperature, their grand friction tends to be large since the grand packing is tightened in order to prevent leakage. Analyzing the behaviors of the system and examining the control scheme, the authors constructed the simulator for practical application. In the consequence of the examination, the authors confirmed that introducing the PI-D control with a gap in the integrator and the minor feedback control of diaphragm pressure to the system would bring out the significant improvement on stability and dynamic response of the system. Moreover, our investigation derived the guideline for tuning the pressure loop-position loop cascading control system.

Keywords: Control valve, Positioner, Hysteresis, Hunting, Actuator, Control device

1. 緒 言

プロセス制御の操作部には調節弁が極めて多く用いられ, その多くはステムの位置制御を主目的とするバルブポジショ ナを使用する.近年のプラント運転の高効率化に伴い,高温・ 高圧ラインに使用される調節弁では、流体の漏れ防止のため にグランドパッキンの締め付け力が増大している.また、プ ラントの運転に要するエネルギーを削減するべく、調節弁に おいても、そのダイヤフラム径を小さくする傾向にある. こ れらは調節弁のヒステリシスを増大させ、調節弁・ポジショ ナ系の制御性能を著しく悪化させる要因となっている.また, プラント運転の最適化は操作部にまで要求されるようになり, 高度な調節弁の制御を実現するべくポジショナの電子・多機 能化も進んでいる^{1),2)}.しかし、高性能なポジショナであって も、それをヒステリシスの大きな調節弁に使用する場合には、 各構成機器が有する非線形要素の相互干渉により不具合を生 じることが少なくない.この不具合を改善するためには、機 器の更なる改良・高性能化が求められるが、電子式ポジショ ナの普及が進みつつあることに留意するならば,離散演算部 での制御手法の改良のみでこれを実現できればより実用的で ある. そこで本論文では、空気圧式調節弁・電子式ポジショ ナを一制御系(システム)と捉え,まず,調節弁のヒステリ シスが大きな場合に見られる不具合現象の発生要因を実験調 査により抽出している. さらに, これを踏まえて制御性能を

* 早稲田大学理工学総合研究センター九州研究所 北九州市 若松区ひびきの 2-2

** 早稲田大学理工学総合研究センター 新宿区喜久井町17

- *** 横河電機(株) 武蔵野市中町 2-9-32
- Kyushu Laboratory, Advanced Research Institute for Science & Engineering,, Waseda University
- ** Advanced Research Institute for Science & Engineering, Waseda University

***Yokogawa Electric Co. (Received May 23, 2003) 向上させるための制御手法を開発し、その有効性を明らかに している.

2. 実験装置

調節弁・ポジショナ系の動特性調査にはシミュレーション モデルを用いた例が多く見られるが³⁾,本論文では,構成要 素中に存在する強い非線形性がシステムの不具合現象に大き な影響を及ぼしていることを重視し,実験調査による検討を 行っている.構築した実験装置の概要図を **Fig.1** に示す.実 験装置は制御対象となる空気圧式調節弁,電子式ポジショナ, そしてポジショナの離散演算機能とデータ測定・記録機能を 担う PC より構成されている.

2.1 空気圧式調節弁

空気圧式調節弁の主要諸元を**Table1**に示す. 接続管口径は 4B (100[mm]), 駆動部のダイヤフラム径は 330[mm]であり, 実際に流体(水)を流した状態での試験も可能となっている ⁴⁾. 調節弁のグランドパッキンには,高温・高圧下での使用を 想定して,石綿系の網組みパッキン (P6610) とピラーフォイ ルのモールドパッキン (P118) の2種を組み合わせている.



Fig.1 Schematic of the control valve-positioner system

Table1 Specifications of control valve

Item	Specification		
Actuator			
Form	Multiple spring		
	/ Single acting diaphragm		
Direction	Air to close		
Maximum range	38 [mm]		
Supply pressure	0.24[MPa]		
Spring range	0.04~0.20[MPa]		
Diaphragm diameter	330[mm]		
Diaphragm effective area	515[cm ²]		
Diaphragm maximum capacity	4510[cm ³]		
Body			
Form	Groove		
Valve size	4B(100[mm])		
Pressure rating	JIS 10K		
Action	Direct action		
Rated CV	140		



Fig.2 Hysteresis characteristics of control valve

2.2 電子式ポジショナ

ステムの位置制御を主目的とする電子式ポジショナは、角 度センサ、離散演算装置としての PC, I/P 変換要素、パイロ ットリレーより構成される. PC を離散演算部とすることで任 意の制御手法の構築が可能となり、その効果を実機にて確認 できる点が大きな特徴と言える. Fig.1 にはポジショナでの ステム位置の制御フローを併せて示している.まず、PC上で ステム位置の目標値が与えられる.この目標値と角度センサ より出力されたステム位置信号とが比較演算され、偏差に基 づく出力信号が D/A 変換器、V/I 変換器を介して電流信号と して出力される.電流信号は I/P 変換要素により圧力信号(ノ ズル背圧)に変換される.このノズル背圧がパイロットリレ ーを操作して、作動空気がダイヤフラム室に供給され、ステ ムを駆動する.位置制御の離散演算周期は 15[ms]であり、調 節弁の動作に比べて十分速い演算周期を実現している.

2.3 計測系

測定するシステムの挙動は、ステム位置(角度センサ)、ダ イヤフラム室内圧力(半導体圧力センサ)、そして調節計の各 演算信号(PC内で演算)である.いずれの測定器も十分な動 特性を持っていることを確認している.以上のデータはポジ ショナでの離散演算周期と同一のサンプリング周期で測定し、 A/D 変換器を介して PC のハードディスク上に保存している. なお、使用する PC の CPU は PentiumII-233MHz である.

3. 調節弁・ポジショナ系の非線形要素

調節弁・ポジショナ系は多くの非線形要素を有し、これら がシステムの応答に大きな影響を及ぼす.そこで、各構成要 素が持つ非線形性を調査・整理する.

3.1 調節弁

本論文は、ヒステリシスの大きな調節弁に使用する電子式 ポジショナの高性能化を実現するための制御手法の開発を目 的としている.実験の再現性を保障するために,前述のグラ ンドパッキンを充填した時の調節弁のヒステリシスが 16%に なるように常に調整し(Fig.2),以降の実験を行っている. このヒステリシスはグランドパッキンの摩擦力(約1300[N]) に起因するもので、ステム位置(フルスパン:0~38[mm])に 対するダイヤフラム室内圧力(フルスパン:0.04~0.20[MPa]) の関係に見るヒステリシスを指す. 図中に示すように、同一 のステム位置であっても、ステムの上昇時(図中赤線)と下 降時(図中青線)でダイヤフラム室内圧力が大きく異なるこ とがわかる.このため、ステムの目標値の変化方向と変化前 のステムの動作方向との関係により、応答に違いが現れる. ここでは便宜上、目標値入力の変化と変化前のステム動作と が同一方向の場合を Forward mode, 逆方向の場合を Reverse mode と呼ぶ. Reverse mode では、ダイヤフラム室内圧力がヒ ステリシス相当分変化するまで(弁軸推力がパッキンの摩擦 力に打ち勝つまで)ステムは動き出すことが出来ない.

3.2 パイロットリレー

ポジショナの一構成要素であるパイロットリレーは, Fig.3 に示すように,給気弁(作動空気を出力室へ供給)と排気弁 (出力室から作動空気を大気へ放出)の2つの機能を担うポ



Fig.3 Detailed view of pilot relay



Fig.4 Static characteristics of pilot relay

ペット弁を持ち、ノズル背圧が主弁体を押す力とバイアスば ねとの釣り合いにより,いずれか一方の弁が開く構造になっ ている.また、機構上、両方の弁が閉じている状態が存在し、 この時は出力圧が応答しないため、給気弁座にはブリード孔 を設けて給気機能を補償している. Fig.4 にノズル背圧(入力) をごく緩やかに上昇、下降させた時の出力圧の測定結果(赤 線)を示す.パイロットリレーの負荷容量が極小さく,また ノズル背圧の変化を準定常とみなせることから、ブリード孔 からの給気のみ(給気弁は全閉)で出力圧がフルスパンにわ たって変化している、これに対して、出力圧室の空気を微小 量大気に放出した時の測定結果を図中青線にて示す. この場 合,給気時にはブリード孔からの給気量のみでは出力圧が上 昇しなくなり、給気弁が開くことになる.しかし、ポペット 弁は供給空気圧によって給気弁座に常に押し付けられており, 給気弁を開くにはこの押し付け力に打ち勝つまでノズル背圧 が変化する必要がある.この間、ブリード孔からの給気量と 大気への放出量が平衡し、出力圧は一定値に保持される.ま た、排気時には、ポペット弁が供給空気圧から受けている力 を全て給気弁座に受け持たせた時点で排気弁が開くため、同 様に出力圧が一定となる領域が存在する. ここでは, 出力圧 一定の下でのノズル背圧の変化分をパイロットリレーの不感 帯幅と定義する.この不感帯は、出力圧をフルスパン操作す るのに必要なノズル背圧の変化量(図中赤線参照)に対して, 無視しえない大きさであることを確認できる. Fig.4 では, この不感帯の影響が準定常的な入,出力特性に現れるように, 微小量の空気を意図的に大気に放出したが、通常の動作状態 では、ブリード孔からのみの給気(不感帯の範囲内)で出力 圧は緩やかに上昇し、ノズル背圧が出力圧の応答速度よりも 速く変化し、かつノズル背圧の変化量がこの不感帯幅より大 きくなる場合に初めて給気弁が開き,出力圧が急激に上昇す ることになる.以上より、パイロットリレーは、ブリード孔 からのみの給気と給気弁からの給気の2段階の給気動作が存 在するために、強い非線形性を持つことを確認した.

3.3 I/P 変換要素

Fig.1 に示すように、ポジショナにおいて電磁アクチュエー タとノズルフラッパは一つのシステム構成要素(I/P 変換要素)と見なしうる.この I/P 変換要素への入力電流とノズル背 圧(出力)との間には磁気回路に起因する大きなヒステリシ スが存在する. I/P 変換要素とパイロットリレーとを組み合わ せ、入力電流をごく緩やかに上昇、下降させた時のパイロッ



Fig.5 Static characteristics of pressure control unit

トリレー出力圧の応答を Fig.5 に示す. Fig.4 に見るように, パイロットリレー単体 (ノズル背圧の変化に対する出力圧の 応答)のヒステリシスは小さいが, I/P 変換要素のヒステリシ スが大きいために,2 つの要素を組み合わせて圧力操作部と して観た場合のヒステリシスは大きくなることがわかる.ま た,磁気回路のヒステリシスは入力電流の変化幅により特性 が異なることから, I/P 変換要素は非線形性が極めて強い要素 と言える.

4. ヒステリシスの大きな調節弁に ポジショナを付帯した場合の不具合現象

ヒステリシスの大きな調節弁に一般的な電子式ポジショナ を使用した場合の不具合現象として,ステム位置制御に微分 先行型 PID 制御(以後 PI-D 制御)を採用した時の,10%幅の 目標値ステップ状変化に対するシステムの応答(調節弁の初 期状態は Reverse mode,初期弁開度 50%)を Fig.6 に示す. ここでは,ステム位置,ダイヤフラム室内圧力,調節計の出 力信号,各調節計での演算信号の応答を取り上げる.調整値 の設定は限界感度法によったが,十分な安定性を得るために 積分時間を長めにしている. Table2 に各調整値を示す.

目標値変化に対して出力信号が大きく変化するため,パイ ロットリレーの給気弁が開き,ダイヤフラム室内圧力が速や かにヒステリシス相当分変化してステムが上昇する.その後,

Table2 Parameter of the position controller

Item	Parameter
Loop gain	120
Integral time	10[s]
Derivative time	0.125[s]



Fig.6 Response of the system with a PI-D position control to step change

ステム位置が目標値に近づくにつれ、調節計では出力信号を 低下させているが、ダイヤフラム室内圧力はさらに上昇し続 けるために、ステムはオーバーシュートすることがわかる(図 中A). これは、第3章で明らかにしたように、圧力操作部が 強い非線形性を有することに起因する. すなわち, I/P 変換要 素のヒステリシスにより出力信号の変化にノズル背圧が追従 せず,また,パイロットリレーでは不感帯の範囲内で給気動 作が行われていることにより、ダイヤフラム室内圧力は緩や かに上昇することになる. また, オーバーシュートに対する 訂正動作はパイロットリレーの排気弁が開いた後に初めて行 われるが、ダイヤフラム室内圧力がヒステリシス相当分変化 するまでステムは停止しており、その後スティックスリップ 運動を生じてステムが瞬時に変位することがわかる(図中B). しかし、ポジショナではこの挙動を制御することができず, また、積分器が微小偏差を許容しないため、訂正動作が繰り 返されてハンチングを生じている.なお,初期弁開度により 給気, 排気応答の速度に差異はあるものの, 全弁開度域でほ ぼ同様の挙動が得られていることを確認している.

現在普及しているポジショナの多くは、機械的な構造によ り比例制御を行うため、スティックスリップ運動により生じ る偏差を定常偏差として許容し、システムを整定させること ができる.しかし、電子式ポジショナは、PI-D 制御を始めと するより高度な制御動作を採用できる利点を有する.PI-D 制 御を採用するならば、比例制御のみに比べて速応性が著しく 向上するが、この利点を生かすためには、目標値近傍での微 小偏差の許容と、調節計の出力信号に対するダイヤフラム室 内圧力の追従性の改善が不可欠となる.

5. ポジショナの制御手法の構築

前章で明らかにした調節弁・ポジショナ系の不具合を改善し、制御性能を向上させるための制御手法について検討する.



Fig.7 Block diagram of PI-D controller with gap in integrator



Fig.8 Configuration of gap in integrator

5.1 積分器入力信号にギャップを設ける効果

PI-D 制御を採用した際に生じるハンチングを抑制してシス テムを整定させるためには、目標値近傍での偏差を許容し、 積分器による訂正動作を停止させる必要がある.そこで、ス テムのスティックスリップ量を考慮して、Fig.7、Fig.8 に示 すように、積分器への入力信号のみに1%幅(±0.5%)のギャ ップを設け、偏差がギャップ内に入った場合には積分演算を 停止(積分器出力信号はそのまま保持)させる方法を採用す る.ギャップ内の偏差に対しては、比例、微分動作のみで制 御を行うことになる.なお、各調整値は前章の実験と同様

(Table2) としている. 汎用のギャップ付き PID 制御⁶と異 なり、ギャップの付与を積分器のみに限定しているのは、ハ ンチングを生じる原因が積分器で偏差を許容しない点にある こと、また、ギャップの範囲内でもステムの位置制御を比例・ 微分動作で行うことにより、定常偏差を極力小さくすること を意図するためである. これにより、16%のヒステリシスを 持つ調節弁に対して、ポジショナを付帯した際に最大 0.5%の 定常偏差を許容することになる. 以上の効果を確認するため に、積分器入力信号にギャップを設けた場合の 10%幅の目標 値ステップ状変化に対するシステムの応答(調節弁の初期状 態は Reverse mode,初期弁開度 50%)を Fig.9 に示す. PI-D 調節計の調整値は Fig.6 の場合と同様であり、積分器の入力 にギャップを設けた点のみが異なる.

実験結果より,ギャップを付与することで,整定時間は長い(ダイヤフラム室内圧力で評価すると約80[s])ものの,ハンチングを起こさずに整定することがわかる.整定時間が長くなるのは,オーバーシュートに対する訂正動作でステムがギャップ内に入って停止した場合に,調節計の出力信号は一定値を保持するものの,ダイヤフラム室内圧力が整定せずに



Fig.9 Response of the system with a PI-D action and gap in integrator to step change

ヒステリシス相当分緩やかに変化して(図中 A),ステムがさ らに変位することによる.すなわち,調節計の出力信号に対 するダイヤフラム室内圧力のゲインが非常に大きく,かつそ の応答が極めて遅いことが整定時間を増大させる要因となっ ている.また,Fig.6 で見られた,目標値近傍でのステムの 緩やかな上昇(圧力操作部の非線形性に起因)に伴うオーバ ーシュートは,ギャップを付与した場合でも同様に発生して いる(図中 B).オーバーシュートに対する訂正動作後に図中 Aの挙動が生じるため,オーバーシュートは好ましくないが, PI-D 調節計の調整値を変更した場合もほぼ同様の挙動になる ことを確認している.よって,圧力操作部の強い非線形性の 影響は,位置制御系の調整値によらず発生し,システムの整 定性を低下させる大きな原因であると言える.

5.2 圧力制御系を付与する効果

システムの整定性を低下させる主要因が、調節計の出力信 号に対するダイヤフラム室内圧力の応答特性にあることから, ここではダイヤフラム室内圧力のフィードバック制御系(圧 力制御系)を付与したカスケード制御系を構築し、その有効 性を明らかにする. 圧力制御系を付与した場合の調節計のブ ロック線図を Fig.10 に示す.まず,これまでと同様にステム の位置制御(PI-D 制御, 積分器入力信号には 1%幅のギャッ プを設ける)が行われ,位置制御調節計から演算信号が出力 される.この出力信号が圧力制御系における目標圧力値とな り、ダイヤフラム室内圧力がフィードバック制御されてステ ムを駆動する.ダイヤフラム室内圧力を中間制御量とする目 的は、位置制御調節計の出力信号に対するダイヤフラム室内 圧力のゲインを小さくすることと, 圧力操作部の非線形性と 応答性を改善することにある. そこで、ダイヤフラム室内圧 力の制御には微分先行型 PD 制御(以後 P-D 制御)を採用す る. 調整値は十分な安定性と高い応答性が得られるように設 定している(後述の一巡ループゲイン K_{IP} =150 に相当). ま た、位置制御系の調整値は、圧力制御系を付与した制御対象 に限界感度法を適用して設定している. Table3 にこの時の



Fig.10 Block diagram of cascade controller

Table3 Parameter of the cascade controller

Item		Parameter
D:+:	Proportional gain	4.39
controller	Integral time	0.665[s]
	Derivative time	0.166[s]
Pressure	Loop gain	150
controller	Derivative time	0.125[s]

各調整値を示す. なお, 調整値の設定例については次章にて 述べる. 以上に構築したカスケード制御を行う時の 10%幅の 目標値ステップ状変化に対するシステムの応答(調節弁の初 期状態は Reverse mode, 初期弁開度 50%)を Fig.11 に示す. ここでは, ステム位置, ダイヤフラム室内圧力, 位置制御調 節計の出力信号の応答を取り上げる.

図中Aに見るように, 圧力制御系を付与することで, ダイ ヤフラム室内圧力が位置制御調節計の出力信号の変化に良好 に追従することがわかる.よって、目標値の変化に対してス テムはオーバーシュートするものの, 訂正動作が速やかに行 われている.また、ダイヤフラム室内圧力の応答速度が速い ために、訂正動作時にダイヤフラム室内圧力がヒステリシス 相当分変化してステムが動き出すまでに要する時間が、位置 制御のみを行う場合(Fig.6, Fig.9)に比べて短くなってい ることを確認できる(図中B). さらに,積分器に付与するギ ャップ内にステムが入った後のダイヤフラム室内圧力の整定 性が著しく向上し、システムの整定時間が大幅に短縮(ダイ ヤフラム室内圧力で評価すると約 5[s]) していることがわか る.以上より、位置制御系に圧力制御系を付与したカスケー ド制御を採用することで、システムの制御性能が飛躍的に向 上することを明らかにした.前章同様に初期弁開度により給 気、排気応答の速度に差異は生じうるが、圧力制御系を付与 することによりその影響は十分小さくなり, 初期弁開度を 50%で代表することに相応の妥当性があるものと考える.な お、他の初期弁開度においても同様の改善効果が得られるこ とを確認している.

ここに提案するカスケード制御では、ダイヤフラム室内圧 力を直接計測するため、実装に際してはダイヤフラムに圧力 センサを新たに設ける必要がある.しかし、管路モデルを用 いてパイロットリレー出力圧からダイヤフラム室内圧力を精 度良く見積りうるため⁶,この演算機能を離散演算部に追加 すれば、多くのポジショナが装備するパイロットリレー出力 圧室の圧力センサで十分代用できるものと考える.



control to step change



Fig.12 System configuration of pressure control system



Fig.13 Response of pressure control system to step change of set point

6. カスケード制御系の調整例

第5章にてその有効性を確認したカスケード制御系の調整 方法について検討する.

6.1 作動空気圧制御系の調整例

カスケード制御系の調整方法を検討するに当たり,まず,2 次制御ループである圧力制御系のみに注目する.ここでは, ステム位置 50%時のダイヤフラム室容量に相当する圧力容器 を,I/P 変換要素,パイロットリレーからなる圧力操作部の負 荷とみなして検討する. Fig.12 に対象とする圧力制御系の構 成図を示す.

ダイヤフラム室内圧力の制御には、十分な安定性を持ちな がらかつ高い応答性を得るために P-D 制御を採用している. 微分時間は制御対象(圧力操作部+圧力容器)に限界感度法 を適用して決定する(*T*_{DP}=0.125[s]).また、圧力制御系の一 巡ループゲイン *K*_{LP} の設定に関しては、圧力操作部の特性が 給気時と排気時で大きく異なることに留意する.ループゲイ



Fig.14 Effect of pressure controller adjusting on response to step change

ンを変えた場合の目標値ステップ入力に対する圧力の応答を Fig.13 に示す. 圧力上昇時には、いずれのループゲイン設定 においても、パイロットリレーの不感帯の影響を受けて、目 標値近傍ではダイヤフラム室内圧力の上昇速度が飽和してい る. さらに、ループゲインを過度に大きくした場合には、先 行している微分動作による制動効果が過剰に現れて、応答性 に変化がほとんど見られなくなることから、給気時の応答に 着目した調整としては $K_{LP} = 150$ とすれば十分である. 一方、 圧力下降(排気)時は、比較的小さなループゲイン設定でも オーバーシュートしやすいことがわかる. よって、排気時の 応答に着目する場合は、位置制御系への干渉を避けて、オー バーシュートが生じないように $K_{LP} = 30$ とする.

給・排気時の応答に基づくゲイン設定の下,カスケード制御 系の応答を評価することで, 圧力制御系の調整値を決定する. 圧力制御系のループゲインを上述の2通りに設定した場合の 10%幅の目標値ステップ状変化に対するシステムの応答(調 節弁の初期状態は Reverse mode,初期弁開度 50%)を Fig.14 に示す. 位置制御系の調整値は前章同様に限界感度法により 決定している.まず,排気時の応答に着目して KIP =30 とす る場合には、位置制御調節計の出力信号に対するダイヤフラ ム室内圧力の追従が悪く(特に出力信号の変化方向の反転時), 積分器に設けたギャップ内でステムを整定させることができ ない. また, 訂正動作時にステムが停止している時間 (ダイ ヤフラム室内圧力がヒステリシス相当分変化する時間)も長 いために、この間の積分器出力信号の増大が顕著になり、ハ ンチングを生じている.一方,給気時の応答に着目して K_{LP} =150とすると、ダイヤフラム室内圧力の追従性が著しく改善 され、システムが速やかに整定することがわかる.前述の通 り、目標圧力値がステップ状に低下する場合には、作動空気 圧の応答はオーバーシュートするが、ステム目標値の下降に 対する位置制御動作でもこれに起因する不具合は見受けられ ず,良好な挙動を得ていることを確認している.これより, カスケード制御を行う際の圧力制御系には、給気時の応答に 着目したゲイン調整を採用することで、圧力操作部の非線形 性が十分に小さくなり、良好な制御動作が得られることを確 認した.

6.2 位置制御系の調整例

前節で明らかにしたように,圧力制御系のループゲインを 適切に設定するならば,位置制御調節計の出力信号に対して ダイヤフラム室内圧力が良好に追従する.よって,システム の応答には位置制御系の調整値の設定が支配的となるため, ここでは位置制御系の調整に3通りの調整則を適用し,応答 の評価を通して調整方法を検討する.ヒステリシスの大きな

Table4 Three ways of controller parameters

Regulated rule	K _{CS}	T _{IS} s	T _{DS} s
Critical gain	4.39	0.665	0.166
Improved critical gain	3.25	1.20	0.109
Chien-Hrones-Reswick	3.57	3.30	0.232

調節弁・ポジショナ系では制御対象がむだ時間(ダイヤフラ ム室内圧力がヒステリシス相当分変化するのに要する時間) を有することから、この点を考慮できる調整則を適用するこ とが望ましい. そこで、これまで採用してきた限界感度法に 加えて,改良型限界感度法で目標値追従型の条件と, Chien-Hrones-Reswick 法で行き過ぎなしの条件を適用する⁵⁾. Table4 に3つの調整則より得た調整値を示す、これより、比 例ゲイン K_{cs} は限界感度法が最も大きく,その他 2 つの調整 則ではほぼ同様となる.積分時間 T_{IS},微分時間 T_{DS}はそれぞ れ大きく異なり、Chien-Hrones-Reswick法, 改良型限界感度法, 限界感度法の順にこれらが小さくなっている.3 通りの調整 則を適用した場合の1%幅の目標値ステップ状変化に対する システムの応答(初期弁開度 50%)を Fig.15 に示す. 調節弁 の初期状態はForward mode の場合と Reverse mode の場合をそ れぞれ取り上げる.10%幅の目標値変化に対する応答では, 目標値変化時の出力信号の操作量が大きくなり、初期状態に よる応答の違いがほとんど現れないため、ここでは両者の違 いがより顕著に現れる1%幅の目標値変化を取り上げている.



Fig.15 Effect of position controller adjusting on response to step change

調節弁の初期状態の違いは、ステムの応答に見るむだ時間 に現れる. すなわち, Forward mode ではわずかなダイヤフラ ム室内圧力の変化でステムが動き出すのに対して、Reverse mode ではダイヤフラム室内圧力がヒステリシス相当分変化 する必要があり、これに要する時間がむだ時間となる.しか し、Chien-Hrones-Reswick 法によるならば、いずれの初期状態 においてもオーバーシュートせずに(積分器に付与するギャ ップ幅を超えずに) 整定することがわかる.一方,改良型限 界感度法を適用すると、限界感度法に比べてオーバーシュー ト量は若干低下するものの(オーバーシュート量はむだ時間 を生じる Reverse mode の方が大きくなる), どちらの場合でも 積分器に設けるギャップ内でステムが整定せず,訂正動作が 行われる. 10%幅の目標値変化に対する応答では、オーバー シュート量が大きいためにその後の訂正動作が速やかに行わ れるが、ここに見るオーバーシュート量はギャップ幅を僅か に超える程度のものである.よって,訂正動作時の出力信号 の変化はごく緩やかなものとなり、目標値の変化後 120[s]が 経過しても整定しないことがわかる.これより, ヒステリシ スの大きな調節弁に使用するポジショナの調整値は、オーバ ーシュートせずに目標値に追従するように設定 (Chien-Hrones-Reswick 法を適用) することが望ましいと言え る. しかし, その場合でも, Reverse mode ではむだ時間が長 くなるため、この点については改善の余地を残す.

7. 結 言

空気圧式調節弁・電子式ポジショナを一制御系として捉え, 調節弁のヒステリシスが大きな場合に起こる不具合を改善し, 制御性能を向上させるための制御手法を検討した.対象とす る調節弁は、高温、高圧下での使用を想定しているため、大 きなヒステリシスを持ち、ポジショナの構成要素の中でも I/P 変換要素,パイロットリレーが強い非線形性を有している. 電子式ポジショナでは、ステムの位置制御に PI-D 制御を採用 できるが、積分器が偏差を許容しないために訂正動作が繰り 返され、ハンチングを生じる不具合を確認した.しかし、こ のハンチングは積分器の入力信号にギャップを設けて、微小 偏差を許容することで整定させうることを明らかにした. さ らに、ダイヤフラム室内圧力のフィードバック制御系を付与 したカスケード制御を導入することで、圧力操作部の非線形 性,応答性が改善されて,調節弁が大きなヒステリシスをも つ場合でも、その制御性能が著しく向上することを明らかに した.ここに提案する2つの制御手法を用いるならば、機器 の新たな追加や改良を行わずとも、離散演算方法の変更のみ で高性能化が図れるため、実用性に優れている.また、本論 文ではカスケード制御系の調整例も示した. 圧力制御系に関 しては、一巡ループゲインを大きくして圧力操作部の非線形 性を低減させることを優先すれば良く, 位置制御系について は、オーバーシュートを生じない調整がシステムの整定性の 点から観て有効であることを確認した.しかし、目標値入力 の変化と変化前のステムの動作とが逆方向となる場合の挙動 には、改善の余地を残すため、引き続き検討を加えたい.

参考文献

- 1) 石塚光正:バルブのスマート化がもたらすもの~ユーザ評価 と開発課題を通して,計装, 44-5, 27/29 (2001)
- 2) 呂,友近:インテリジェントポジショナからインテリジェントバルブへの進展,計装,44-5,35/38 (2001)
- 3) たとえば、香川、清水、本田、小山:空気圧パイロット弁の 非線形性を考慮した電空ポジショナの特性解析、計測自動制 御学会論文集、29-11、1337/1341 (1993)
- 4) 本格運用が期待されるバルブ実流総合試験設備,計装, 40-5, 1/3 (1997)
- 5) 須田信英: PID 制御, 朝倉書店, (1992)
- 6) 浦田,藤田,香川,黒田,稲垣:分離型調節弁の制御性に関する研究,第2回流体計測制御シンポジウム,01SY0015,53/56 (2001)

[著者紹介]



(正会員)

2001年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課 程修了.博士(工学).99年日本学術振興会特別 研究員,2001年早稲田大学理工学総合研究センタ 一助手,現在に至る.動力システムの力学的挙動・ 制御問題の解明及びその最適設計に関する研究に 従事.日本機械学会,電気学会他会員

橋 詰 匠 (正会員)



79年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程 修了.工学博士.76年同大学理工学研究所助手, 同専任講師,同助教授を経て,87年同教授,現在 同大学理工学総合研究センター教授.エネルギ ー・動力システムに関する研究等に従事.日本機 械学会,電気学会他会員

西島剛志



81年東京都立大学理学部物理学科卒業.同年(株) 北辰電機製作所((現)横河電機(株))入社.バ ルブポジショナ,電磁流量計,温度伝送器など, フィールド機器の開発に従事.現在に至る.

石井 実



99 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修 了. バルブポジショナの高性能化に関する研究に 従事. 同年,横河電機(株)入社. 航空宇宙分野 における電気および機械設計に従事.現在に至る.